深さ分解XMCD法で見るCO, NO吸着Fe/Cu(001)の表面磁性

○ 阿部 仁¹, 雨宮 健太², 酒巻 真粧子², 香西 将吾³, 近藤 寛¹
¹ 慶應大 理工 化学, ² 高エネ機構 物構研, ³ 慶應大 院理工

磁性薄膜の磁気構造は分子吸着の影響を受け、 例えば吸着 CO は Co/Pd(111)の面直磁化を安定 化すると報告されている[1]。ところが、典型的な 磁性薄膜と言える Fe/Cu(001)への分子吸着の実 験は殆ど行われていなかった。そこで我々は一様 な面直磁化を示す4 ML 以下の Fe/Cu(001)に対 し、CO 吸着、NO 吸着の磁気構造への影響を深 さ分解 XMCD[2]を用いて調べたので報告する。

PF BL-7A, 11A にて Fe L 端 XMCD 測定を 行った。試料は超高真空チェンバー内で Cu(001) 上に Fe を蒸着作製し、そのまま測定した。磁化 方向は CO, NO 吸着前後で直入射 (NI)、斜入射 (GI) 測定を行い決定した。深さ分解 XMCD 測 定ではイメージング型検出器を用いた。測定は ~120 K で行った。

CO 吸着前後の Fe(4 ML)/Cu(001)の XMCD スペクトルを図 1(a,b) に示す。吸着前は NI の XMCD 強度が GI の 2 倍で、面直磁化である。吸 着後は NI の XMCD が消え面内磁化となった。さ らに、スピン磁気モーメントが見かけ上半減し

ていた。これは、深さ分解XMCD測定の解析から、図1(c)に示すように表面2MLの磁化が消失したためであることがわかった[3]。当日は薄膜のEXAFSの測定結果も示したい。

次に、NO 吸着の影響を調べた。吸 着前は面直磁化で、スピン磁気モーメン ト $m_s^{\text{eff}} = 2.5 \mu_{\text{B}}$ であったが、吸着後は 面内磁化となり $m_s^{\text{eff}} = 1.2 \mu_{\text{B}}$ と半減し た。磁気構造の詳細を調べるため深さ分 解 XMCD 測定を行った。図2に得られ た一連の XMCD スペクトルを示す。解 析して得られた m_s^{eff} の検出深度依存性を 検討した結果、図2(b)に示すような表面 反強磁性モデルが実験を良く再現した。

本研究では、太田俊明教授を始め多 くの方々のお世話になった。また、日本 学術振興会、慶應義塾学事振興資金の支 援を受けた。ここに謝意を示したい。



Figure 1: (a,b) CO 吸着前後の Fe XMCD スペクトル。実線は NI, 破線は GI。(c) 深さ分解 XMCD から得られた 表面磁化消失モデル。



Figure 2: (a) 深さ分解 XMCD 測定で得られた NO/Fe(4 ML)/Cu(001) のスペクトル。(b) 磁気 構造モデル。最表面層の磁化が逆向き。

- [1] D. Matsumura, et al., Phys. Rev. B 66, 024402 (2002).
- [2] K. Amemiya, et al., Appl. Phys. Lett. 84, 936 (2004).
- [3] H. Abe, et al., Phys. Rev. B 77, 054409 (2008).